

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】平成24年6月28日(2012.6.28)

【公表番号】特表2011-522987(P2011-522987A)

【公表日】平成23年8月4日(2011.8.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-031

【出願番号】特願2011-509479(P2011-509479)

【国際特許分類】

F 0 1 N 3/24 (2006.01)

F 0 1 N 3/08 (2006.01)

F 0 1 N 5/02 (2006.01)

F 0 2 C 6/18 (2006.01)

F 0 1 K 23/10 (2006.01)

B 0 1 D 53/94 (2006.01)

【 F I 】

F 0 1 N 3/24 Z A B L

F 0 1 N 3/08 B

F 0 1 N 5/02 G

F 0 2 C 6/18 A

F 0 1 K 23/10 U

B 0 1 D 53/36 1 0 1 A

B 0 1 D 53/36 1 0 3 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年5月11日(2012.5.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

熱回収蒸気発生装置中の触媒区域に最適な温度範囲を維持する方法であって、
ガスタービンの排気流の第一部分を第一熱交換機の経路中に入れること、
 前記排気流の一つ以上の第二部分を分岐させ、前記第一熱交換機を回避させ、その際、
 前記第一熱交換機の後で、前記第二部分を前記第一部分と組み合わせること、及び
 前記組み合わせられた第一部分及び第二部分を触媒区域と接触させることを含んでなり、
前記触媒区域が、
一個以上の還元剤注入点と、
一種以上のSCR触媒と、
前記一種以上のSCR触媒の上流に、又は前記一個以上の還元剤注入点の下流に、配置さ
れた一種以上のCO触媒とを備えてなる、方法。

【請求項2】

前記触媒区域が、約715°F～約815°Fの温度を有してなり、
 前記第二部分の温度が前記組み合わせられた第一部分及び第二部分の温度以上のものである、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記組み合わせられた第一部分及び第二部分を、前記触媒区域の下流に配置された第二熱交換機と接触させることをさらに含んでなる、請求項1又は2に記載の方法。

【請求項 4】

熱回収蒸気発生装置中の触媒区域に最適な温度範囲を維持する方法であって、
ガスタービンの排気流の第一部分を第一熱交換機の経路中に入れること、
前記排気流の一つ以上の第二部分を分岐させ、前記第一熱交換機を回避させ、かつ、前記第二部分を一個以上の過熱器と接触させることを回避させ、その際、前記第一熱交換機の後で、前記第二部分を前記第一部分と組み合わせること、及び
前記組み合わせられた第一部分及び第二部分を触媒区域と接触させることを含んでなり、
前記触媒区域が、
一個以上の還元剤注入点と、
一種以上のSCR触媒とを備えてなる、方法。

【請求項 5】

前記触媒区域が、約 715 °F ~ 約 815 °F の温度を有してなり、
前記第二部分の温度が前記組み合わせられた第一部分及び第二部分の温度以上のものである、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記第一熱交換機の前で前記ガスタービンの排気流の第一部分の温度が、約 825 °F ~ 約 1100 °F である、請求項 4 又は 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記組み合わせられた第一部分及び第二部分を、前記触媒区域の下流に配置された第二熱交換機と接触させることをさらに含んでなる、請求項 4 ~ 6 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 8】

前記触媒区域が、前記一種以上のSCR触媒の上流に配置された、一種以上のCO触媒をさらに備えてなる、請求項 4 ~ 7 の何れか一項に記載の方法。